センサガスクロ

Sensor Gas Chromatograph

昇温脱離型　水素分析装置

PDHA-1000

昇温脱離型水素分析装置（PDHA-1000）は、昇温脱離装置（SDS-P1）とセンサガスクロマトグラフ（SGHA-P2）で構成されており、金属固体材料からの脱離水素を高感度に分析出来ます。

センサガスクロマトグラフ（SGC）は、カラムにオリジナルショートカラムを、検知器に半導体ガスセンサを採用することにより、高速分離と高感度計測を実現したガスクロマトグラフです。

センサガスクロマトグラフ（SGC）

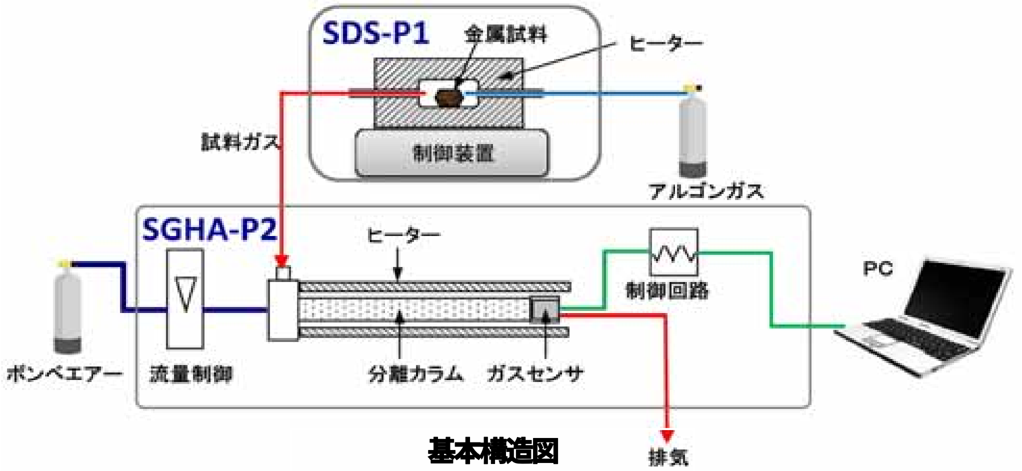
注：パソコンは付属品に含みません。

昇温脱離装置(SDS)

主な特徴

※ ご要望に応じてカスタマイズ致します。

- ◆ 半導体ガスセンサを使用した高感度計測（0.01～10ppm）
- ◆ アルゴンガス中大気圧での測定 ＝ 一般環境下と同等条件での評価が可能
- ◆ 昇温範囲は 室温～500℃、昇温速度は 1～20℃/min の範囲で可変
- ◆ 1つの測定点での計測周期は最短2分
- ◆ PC による自動計測と演算結果のグラフ表示及びデータ保存機能
- ◆ 設置場所を選ばない小型サイズ（SGC：約 B4 サイズ、SDS：約 A3 サイズ）
- ◆ 水素測定に特化することにより高いコストパフォーマンスを実現



基本構造図

SGC

仕　様

項　　目	内　　容
型　式	PDHA-1000
計測方式	半導体ガスセンサを検知器としたガスクロマトグラフィー
測定対象ガス	水素
測定単位	ppm
測定濃度域	0.01～10ppm
最小表示分解能	0.001ppm
初期安定化時間	5～60 分 (※1)
計測時間	最短計測周期　2 分
試料ガス注入量	6cc/回　(パージガス量 4cc＋計測ガス量 2cc)
測定結果の表示	パソコンによる測定結果の表示 (※2)
測定方式	自動サンプリング装置によるガス注入方式
キャリアガス	SGHA：空気　(水素フリー、流量固定) SDS：アルゴンガス　(0～100cc/min　流量可変)
試料設置空間	φ10×15mm
昇温範囲	室温～500℃の範囲で可変　(1℃単位)
昇温速度	1～20℃/min の範囲で可変　(1℃単位)
冷却法	炉解放による自然冷却
ソフトウエア	外付け PC (別売) による結果グラフ表示及びデータ保存
配管接続仕様	SGHA：φ4 継手　(高純度空気ボンベ接続) SDS：1/16 スウェージロック　(アルゴンガスボンベ接続)

電　源	AC 100V
消費電力	SGHA：約 40VA SDS：約 550VA
外形寸法/重量 (突起部含まず)	SGHA：260(W)×135(H)×340(D) mm　　約 6kg SDS　：370(W)×330(H)×440(D) mm　　約 13kg
設置場所	室内専用
使用環境	10～30℃　80%RH 以下　(結露なきこと)
保存環境	-20～60℃　20～80%RH　(結露なきこと)

(※1)　機器の安定度により、自動的に時間調整します。
(※2)　専用の測定および測定結果解析プログラムが付属しています。(パソコンは含みません)

カタログに記載されている仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

FIS TECHNOLOGY

エフアイエス株式会社
〒664-0891
兵庫県伊丹市北園 3-36-3
Tel　：072-780-1800
Fax：072-785-0073
E-mail：info@fisinc.co.jp
URL：http://www.fisinc.co.jp

(販売代理店)